

## 会社概要 (2025年6月30日現在)

|         |   |
|---------|---|
| 社名      | レーザーテック株式会社   |
| 所在地     | 〒222-8552<br>神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1                        |
| 設立      | 1962年8月   |
| 資本金     | 9億3,100万円   |
| 主な事業内容  | 下記製品の開発・製造・販売・サービス<br>1. 半導体関連装置 2. FPD関連装置<br>3. レーザー顕微鏡 |
| 従業員数    | 連結 1,163名 単体 516名   |
| お問い合わせ先 | 045-478-7127 (企画管理部)                                      |

## 株式情報 (2025年6月30日現在)

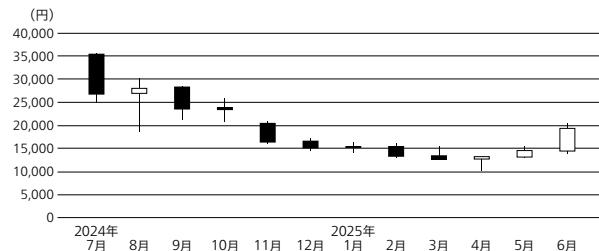
### 株式概要

|         |               |
|---------|---------------|
| 上場市場    | 東京証券取引所プライム市場 |
| 発行済株式総数 | 94,286,400株   |
| 株主数     | 108,079名      |
| 大株主一覧   |               |

|   | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---------|---------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                       | 16,505  | 18.30   |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)                            | 6,509   | 7.21    |
| 内山 洋  | 2,813   | 3.11    |
| 内山 秀  | 2,788   | 3.09    |
| 前田 せつ子  | 2,734   | 3.03    |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,672   | 1.85    |
| 株式会社三菱UFJ銀行                                   | 1,504   | 1.66    |
| UCHIYAMA HOLDINGS株式会社                         | 1,477   | 1.63    |
| 高橋 はる香  | 1,440   | 1.59    |
| 楽天証券株式会社                                      | 1,044   | 1.15    |

(注) 1. 当社は、自己株式を4,096千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
2. 持株・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

### 株価の推移



### 取締役および監査役 (2025年9月26日現在)

|                 |               |                |               |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 代表取締役<br>社長執行役員 | 取締役<br>会長執行役員 | 取締役<br>副会長執行役員 | 取締役<br>常務執行役員 |
| 仙洞田 哲也          | 岡林 理          | 楠瀬 治彦          | 田島 敦          |

|                                 |       |                |
|---------------------------------|-------|----------------|
| 取締役(社外)                         | 常勤監査役 | 監査役(社外)        |
| 三原 康司<br>岩田 宜子<br>石黒 美幸<br>由利 孝 | 浅野 政克 | 出雲 栄一<br>道 あゆみ |

### 株主メモ

|          |   |
|----------|---|
| 事業年度     | 7月1日から翌年6月30日まで   |
| 定時株主総会   | 毎年9月  |
| 基準日      | 毎年6月30日(なお、その他必要あるときは、あらかじめ公告した日)   |
| 単元株式数    | 100株  |
| 株主名簿管理人  | 三井住友信託銀行株式会社  |
| 特別口座管理機関 | (同上)  |
| 同連絡先     | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部<br>電話 0120-782-031(通話料無料)<br>郵送先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |

公告掲載URL <https://www.lasertec.co.jp>

ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。



(ご注意)

- 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社など)にお問い合わせください。株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関(三井住友信託銀行)にお問い合わせください。なお、三井住友信託銀行全国各支店においてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行の本支店でお支払いいたします。

### 当社Webサイトのご案内

<https://www.lasertec.co.jp/ir/>

日興アイ・アール株式会社の「2024年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」にて総合部門最優秀サイトに選ばれました。



▼ Gomez / IRサイト総合ランキング銅賞(2024年)



UD FONT

## 株主通信

# Lasertec News 33

証券コード6920

第63期

2024年7月1日▶  
2025年6月30日

Inventing for your success,  
inventing for the future

Lasertec



## 当期の業績と事業環境

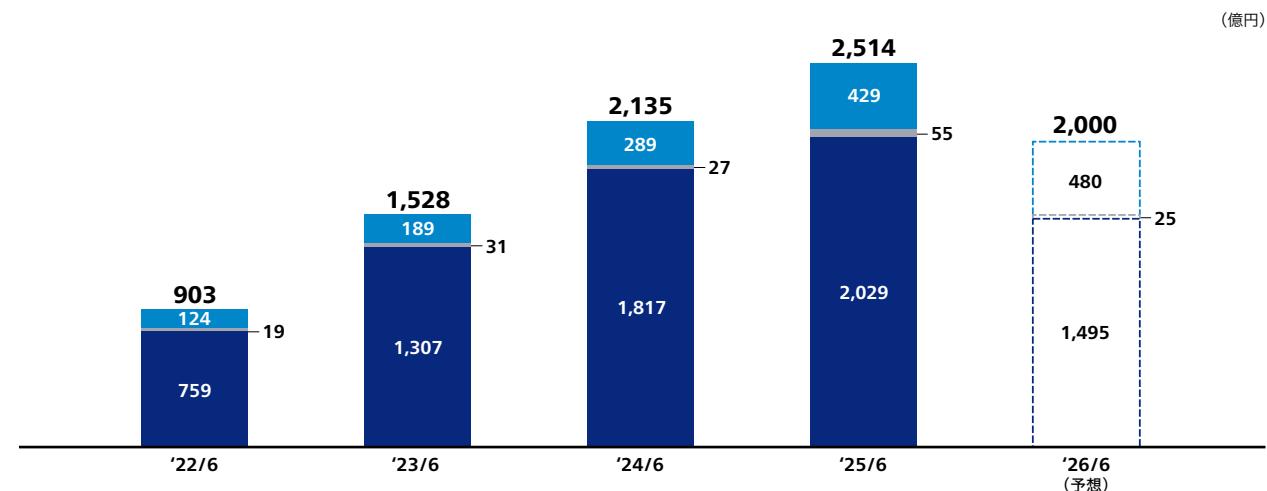
当期の世界経済は、地政学リスクや主要国の政策動向による景気減速が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続きました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、スマートフォンやパソコン向け半導体の需要は軟調に推移した一方で、データセンター向けAIサーバーやHBM（広帯域メモリ）等のAI関連の半導体需要が市場を牽引しました。また、パワー半導体関連の需要はEV（電気自動車）市場の停滞を背景に低調に推移しました。

当期の業績については、売上高が2,514億77百万円（前連結会計年度比17.8%増）、営業利益が1,228億43百万円（同51.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益が846億52百万円（同43.3%増）となりました。受注高は1,052億26百万円（同61.4%減）、期末受注残高は3,159億45百万円（同31.6%減）となりました。

代表取締役  
社長執行役員 **仙洞田 哲也**

製品別売上高 ■ 半導体関連装置 ■ その他 ■ サービス

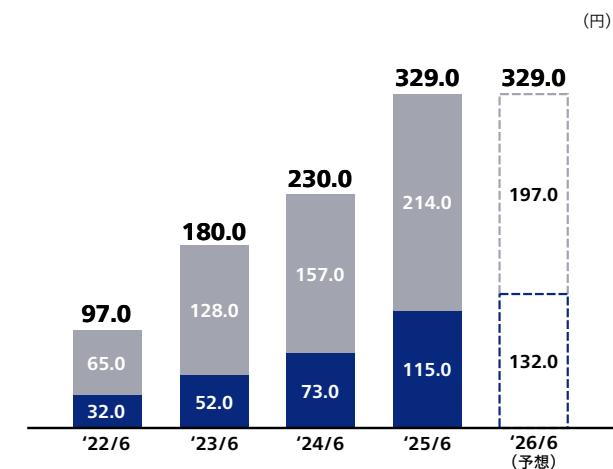


## 当期の配当

当社は、連結での配当性向35%を目安として、業績に応じた弾力的な配当政策を行うことを利益配分に関する基本方針としております。内部留保は、新技術・新製品の研究開発投資や優秀な人材の獲得などへ有効に活用し、企業体質の一層の強化と長期安定的な経営基盤の確立に役立てていく方針です。

この方針に基づき、当期末配当金は1株当たり214円、年間配当金は前期比99円増配の329円（連結配当性向35.1%）とさせていただきます。

1株当たり配当金 ■ 中間 ■ 期末



期末配当金

6月末日を基準日とする配当金は

**1株当たり214.0円**

とさせていただきます

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 年間配当金 | 2025年6月期 | 329.0円 |
|       | 2024年6月期 | 230.0円 |

また、事業環境、成長投資の機会、足元の資金効率、財務健全性および株価水準などを総合的に勘案し、企業価値向上と株主還元の実現を目的として、取得総額120億円(上限)、取得総数100万株(上限)とする自己株式取得を決定いたしました。

注目製品

当期、マスク関連分野で三つ、ウェハ関連分野で一つの新製品をリリースいたしました。

マスク関連分野の一つ目は、EUVマスクブランクス欠陥検査/レビュー装置ABICSの次世代機E320です。新設計の高倍率光学系の採用と照明光学系の最適化により、従来機のE120シリーズと比べてさらなる高性能化を実現いたしました。

二つ目、三つめ目は、EUVペリクル異物検査装置PELMIS EPM100と、PELMISシリーズの最新モデルのEPM200です。本シリーズは、近年EUV市場の拡大に伴い検査需要が高まっている、EUVマスクに取り付けられたペリクルと呼ばれる保護膜に付着した異物を高精度に検査し、さらにその異物の付着場所の表裏自動判別を実現した製品です。最新モデルとなるEPM200は、次世代EUVペリクルとして注目されるCNT(カーボンナノチューブ)ペリクルの検査に対応した装置です。従来困難とされていたCNTペリクル上の微細な異物の検出や、表裏自動分類機能をいち早く実現しており、加えて欠陥種別判定などの多様な機能を搭載することで、ペリクルメーカーやデバイスメーカーにおける品質管理の高度化を可能にしています。

ウェハ関連分野では、SiCウェハの表面および内部欠陥の高速検出と高精度分類までを同時に行えるSiCウェハ欠陥検査/レビュー装置SICA108を発表

いたしました。SiCパワーデバイスは、EVや太陽光発電システム等での活用が進む一方で、ウェハ製造プロセスの難しさから歩留まり向上とコスト低減が課題となっています。そのような課題を解決すべく製品化したSICA108は、業界標準機として多くのお客様に採用いただいている従来機SICA88から検査光学系を刷新し、スループットのさらなる高速化、SiCウェハの品質把握とコスト改善を実現しました。

今後の取り組み

足元では厳しい事業環境が続いており、当期の受注高は1,052億円と前期を大きく下回りました。しかし、半導体需要はさまざまな用途で拡大を続け、2030年には1兆米ドル市場になると予想されております。また、半導体の進化を支える微細化、新材料、新構造の技術トレンドに変化はなく、各分野においてお客様目線の製品、サービスを提供し続けることにより中長期的な成長機会があると考えております。

当期から2030年6月期までを対象とする中期経営計画がスタートし、「圧倒的な開発スピード、高い技術力、顧客との強固な信頼関係の構築により売上最大化とさらなる成長を目指す」という方針のもと、取り組みを進めております。施策として掲げた「リードタイムの短縮」においては、リソースの最適化や製造・装置立ち上げ工程の改善等を通じて、主力製

このようなお客様ニーズにお応えする新製品の発表もあり、2025年4月には、当社の主要顧客であるインテル コーポレーションより「EPIC Supplier Award」を受賞いたしました。本賞は、同社のサプライチェーンにおける当社の品質改善と優れたパフォーマンスが評価されたことによるものです。今後も当社は、お客様に寄り添い課題解決に向けたソリューションの提供を続けてまいります。

品を含む多くの製品で受注から納品までの期間を目標の0.5~1.5年に向け、大幅に短縮することに成功しました。

また、二つ目の施策である「サービスビジネスの拡大」も、目標であるサービス売上高構成比率20%以上に向け取り組みを進めております。これは、納入済み製品のメンテナンスや消耗品の交換に関わるビジネスで、当社製品をお客様に安心してご使用いただくためには、サービス体制の強化が不可欠です。お客様からさらなる信頼を獲得し、今後のビジネス拡大につなげるためにも、誠実かつスピーディーな対応に一層磨きをかけてまいります。

今後も外部環境の変化に柔軟に対応しつつ、お客様の満足度向上と中長期的な企業価値の向上を目指し、中期経営計画を着実に推進いたします。

前連結会計年度比 17.8% ↗ **売上高** 2,514億77百万円

前連結会計年度比 61.4% ↘ **受注高** 1,052億26百万円

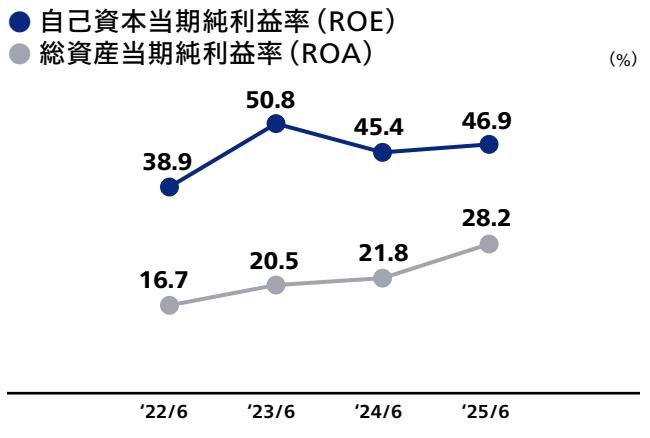
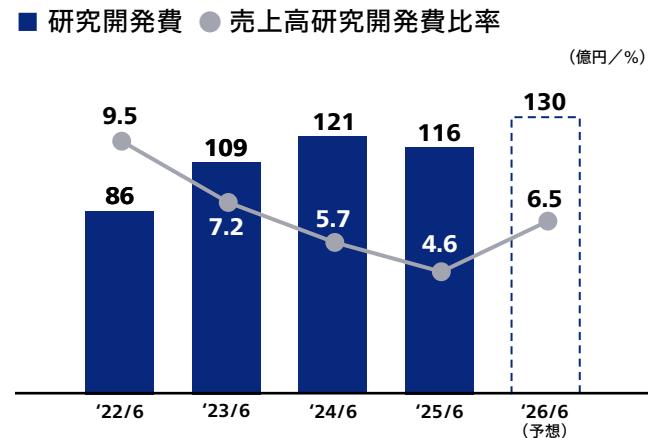
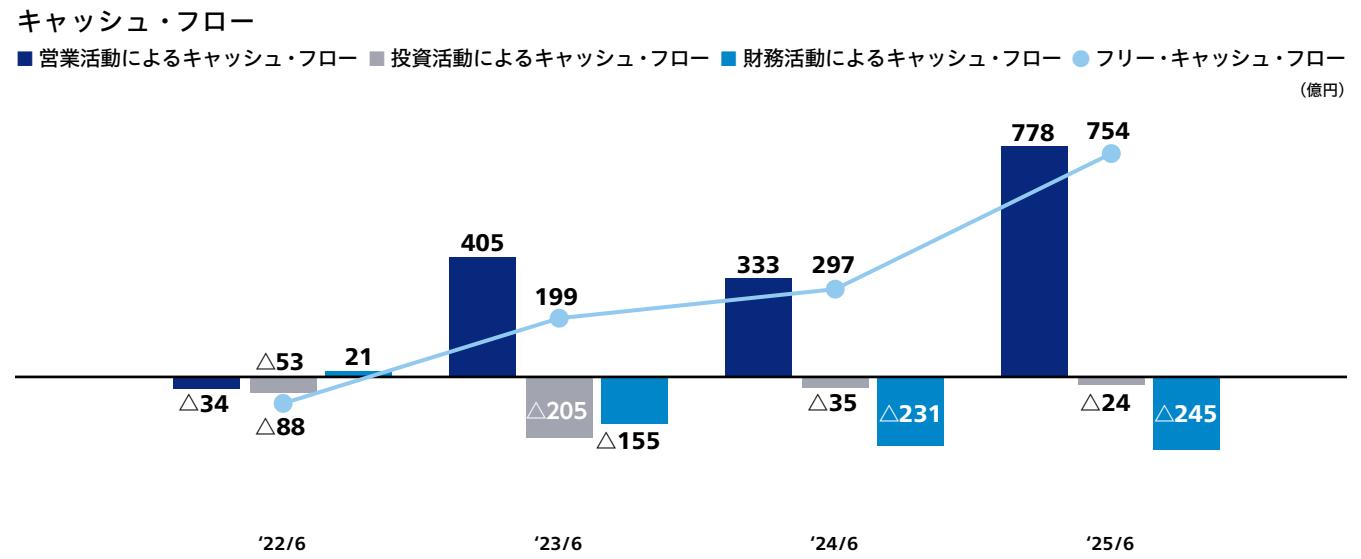
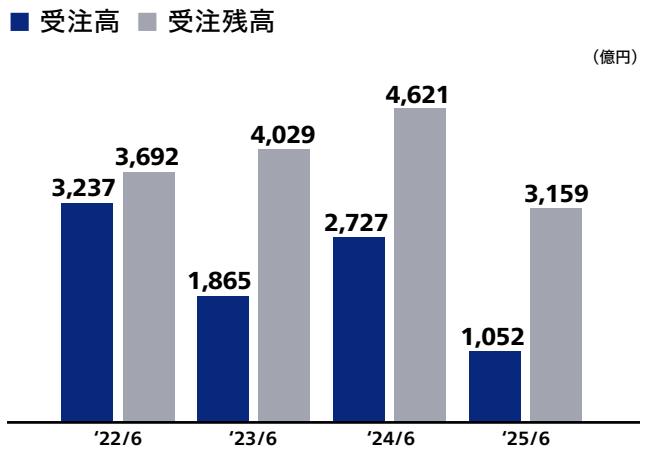
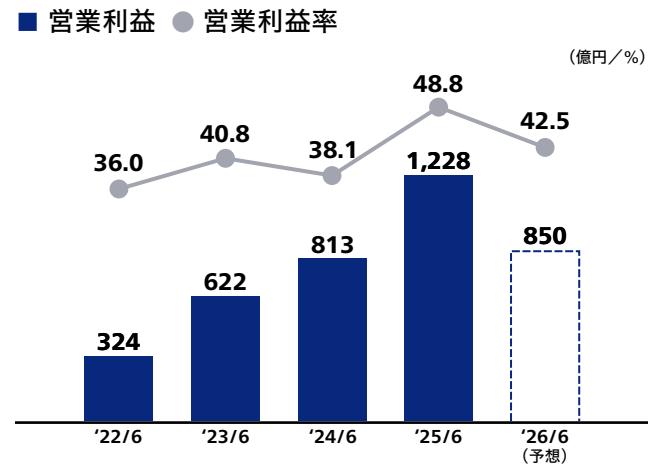
前連結会計年度比 51.0% ↗ **営業利益** 1,228億43百万円

前連結会計年度比 43.3% ↗ **当期純利益** 846億52百万円

親会社株主に帰属する

**自己資本** 2,098億78百万円

**資産合計** 3,296億1百万円



### 決算のポイント

#### 純資産合計

株主資本にその他の包括利益累計額および新株予約権を加えた純資産合計は2,099億円となりました。自己資本比率は63.7%で、引き続き財務の健全性を維持しています。

#### 売上高/利益

半導体関連装置の売上が貢献し、売上高、利益ともに大幅に増加となり、9期連続で過去最高額を更新しました。

#### 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益などによる収入が、法人税等の支払い、棚卸資産などの支出を上回りました。

2025年  
1月20日  
発表

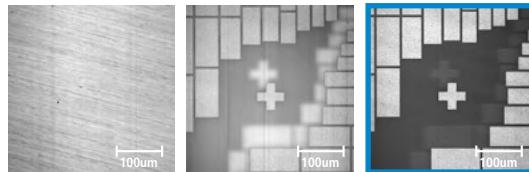
## IRコンフォーカルマイクロスコープ OPTELICS IR

当社は、ユニークで付加価値の高い製品群の一つとして、主に研究開発目的での観察・測定に用いるコンフォーカル顕微鏡を開発し販売しています。このたび製品化したOPTELICS IRは、高輝度な赤外線（以下IR）照明によるコンフォーカル光学系を搭載し、非破壊・非接触での高解像度IR観察と高精度な測定を実現します。シリコンウェハをはじめとする、IRを透過する材料を用いたデバイスの内部観察に有効です。特に、近年急速な発展を遂げている半導体の先進パッケージ市場において、貼り合わせズレ量測定、ボイド\*1検査や接着剥がれの観察など、研究開発やプロセス改善の用途に最適な顕微鏡です。

\*1 ボイド：金属や半導体材料の内部に存在する微小な空洞や穴のこと

### 可視光観察では見えない領域をIR光で捉える

3Dパッケージや、SiP (System in Package) などの可視光では見えない領域の観察・測定・検査を非破壊で実現



可視光画像

ノンコンフォーカル  
IR画像

OPTELICS IR画像



2025年  
5月9日  
発表

## 電気化学反応可視化コンフォーカルシステム ECCS B520

当社は長年にわたり電池市場にECCSシリーズを提供し、電気自動車やスマートフォン向けリチウムイオン電池の品質向上に貢献してきました。主に研究開発、不良解析の分野において高い評価を得ています。近年、全固体電池の研究が盛んに行われており、特に硫化物系全固体電池においては電池の性能と安全性向上のために高い拘束

圧が必要とされています。このたび製品化したECCS B520は、これまで実現が難しかったメガパスカル級の圧力を観察対象に均一にかけつつ、Operando観察\*2と計測を可能にしました。また、ECCS B520の光源を従来のキセノンランプからLEDに一新し、長寿命化と輝度の長期安定性を達成しました。

\*2 Operando観察：ラテン語の「operando」（動作中、活動中）に由来し、化学反応や物理現象をその場で観察すること

2025年  
7月11日  
発表

## CNT(カーボンナノチューブ)ペリクル対応の EUVペリクル異物検査装置 PELMIS EPM200

PELMIS EPM200は、CNTペリクル\*3の異物検査を可能としたPELMISシリーズの最新モデルであり、ペリクル面の異物検査に加え、従来は不可能とされていた付着異物の表裏自動分類機能をいち早く実現しました。さらに、欠陥種別判定などの多様な機能を搭載しており、ペリクルメーカーやデバイスメーカーまで幅広くお使いいただくことで、CNTペリクルの品質管理に貢献する装置です。

また、当社は今回リリースしたPELMISのほか、アクティニック\*4EUVパターンマスク欠陥検査装置 ACTISシリーズ、マスク検査装置 MATRICSシリーズ、EUVマスク裏面検査/クリーニング装置 BASICシリーズ、EUVマスクブランク欠陥検査/レビュー装置 ABICSシリーズといった、EUV関連検査装置を幅広く提供しています。これにより、ブランクメーカーからペリクルメーカー、デバイスメーカーに至るEUVマスク関連の多様な工程に対応する検査体制を構築しています。

\*3 ペリクル：マスクへ異物が付着するのを防ぐ保護膜  
\*4 アクティニック (Actinic)：露光装置と同じ波長の光



### EUV関連検査装置を幅広く提供



2025年 4月 9日

## インテル コーポレーションより 2025年度EPIC Supplier Awardを受賞

インテル コーポレーションより「2025年度EPIC Supplier Award」を受賞しました。数千社にのぼるインテルサプライヤーの中で、EPICサプライヤープログラムへの参加資格を有する企業はわずか数百社のみです。今年の受賞企業は37社で、当社は4年連続の受賞となりました。お客さまの期待を上回るパフォーマンスを発揮した顧客重視の成果や取り組みが、インテル コーポレーションの成長に貢献したとして評価されました。



## 研究開発拠点InnoPa (イノパ) \*1 第2期工事完了

InnoPaは、将来を見据えた業容拡大への対応、業務効率の向上と経営基盤の強化を目的として2022年に取得した研究開発拠点です。2023年6月に第1期工事が完了し、敷地内にある5棟の建物のうち1棟をクリーンルーム化いたしました。今回の第2期工事では新たに別の建物のクリーンルーム化が完了し、生産能力の向上に寄与し始めました。なおその他の建物については、当面の間は研究開発、執務場所および倉庫として活用します。

\*1 InnoPa (イノパ) : Lasertec Innovation Parkの通称



InnoPa外観

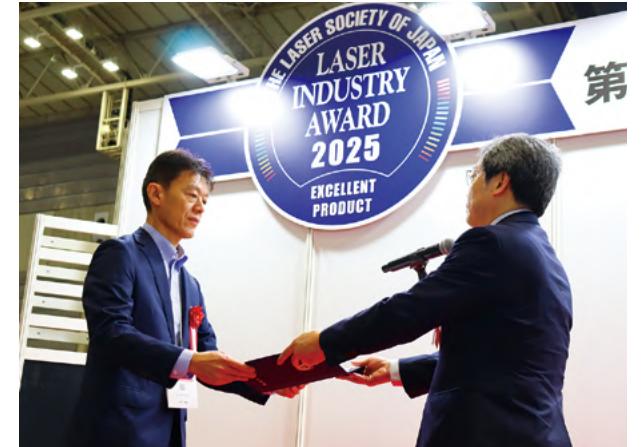


クリーンルーム 内部

2025年 4月 24日

## 第17回レーザー学会産業賞 「優秀賞」受賞

当社が開発した「高輝度EUVプラズマ光源 URASHIMA」が、一般社団法人レーザー学会より、レーザー学会産業賞「優秀賞」を受賞しました。URASHIMA光源は、EUVフォトマスク検査に対応する高輝度EUVプラズマ光源で、ペリクルの熱負荷抑制と安定した検査用照明の両立により、従来技術の課題を解決することに成功しました。同光源を搭載したACTISシリーズはEUV露光プロセスにおけるマスク欠陥の高感度・高精度検査を可能にし、世界的な半導体メーカーの製造現場で広く採用されています。これらの技術革新と業界への貢献を高く評価され当社は「優秀賞」を受賞しました。



### URASHIMA光源の特長

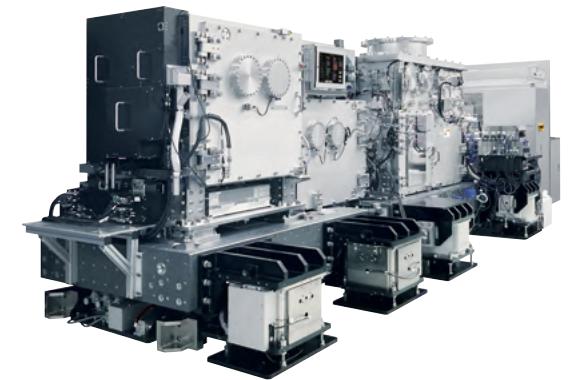
高輝度

高い安定性

エコ  
(低消費電力、低スズ消費)

デブリフリー\*2

検査に最適なプラズマサイズ



高輝度EUVプラズマ光源 URASHIMA

\*2 デブリフリー：EUV光が発生する際に飛散するデブリ（原材料のスズの粒子）を大幅に削減